

科 目 名
<b>LSI システム</b> <b>LSI System Configuration</b>

3年 後期 2単位 選択

青木 振一

## 概 要

日本はアメリカと共に IT 技術をリードしてきている。特にハードウェアに関しては、半導体微細化技術の点で1980年代、DRAM を中心として世界の最先端をリードしてきた。しかしながら1990年代に入り、投資環境、経営環境等の変化により、韓国、台湾等の東南アジアおよび欧米の DRAM 専業メーカーに追従できなくなった。このような環境に対応するため、近年の高機能半導体は、セットメーカーからの小型化、軽量化、高性能化への要求に応え、得意とするシステムソリューションをベースとするシステム LSI に活路を見出すべく方向転換を進めている。システム LSI は、従来、複数の IC で構成されていたシステムブロックを1チップ化により電子機器の一層の高機能・高性能化の実現に向け、半導体技術の結晶として期待が高い。本講義では、システム LSI の作り方を設計から製造、組立、検査まで工程順に解説していく。

## 目 標

- 1) システム LSI の概念の習得
- 2) 設計工程とそのフローの理解
- 3) ウェハー技術と組込み技術の理解
- 4) LSI 検査技術の理解

## 授業計画

テーマ	内 容
1. LSI システムとは 1	半導体の歴史
2. LSI システムとは 2	LSI の用途例
3. LSI システムとは 3	LSI チップと回路ブロック
4. 設計工程 1	設計工程フロー
5. 設計工程 2	システム設計
6. 設計工程 3	機能論理設計
7. ウェハー行程 1	ウェハー行程フロー
8. ウェハー行程 2	シリコン技術
9. ウェハー行程 3	結晶成長とエピタキシャル
10. マスク行程	LSI システム用フォトマスクとパターン形成
11. 組立行程 1	組立工程全体フロー
12. 組立行程 2	SiP (システムインパッケージ)
13. 検査工程 1	ウェハー検査とパッケージテスト
14. 検査工程 2	故障解析とテスティングの課題について
15. 次世代 LSI	新世代 LSI システムの課題と将来像

## 評価方法

理解度チェックミニテスト、レポート課題、定期試験の総合で評価する。

## 教 材

資料の配付